【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】令和3年10月21日(2021.10.21)

【公開番号】特開2019-164325(P2019-164325A)
【公開日】令和1年9月26日(2019.9.26)
【年通号数】公開・登録公報2019-039
【出願番号】特願2018-203709(P2018-203709)
【国際特許分類】
Ｇ０２Ｂ　5/18　(2006.01)
Ｇ０１Ｃ　3/06　(2006.01)
Ｇ０６Ｔ　1/00　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｇ０２Ｂ　5/18
Ｇ０１Ｃ　3/06　１２０Ｓ
Ｇ０６Ｔ　1/00　４２０Ｆ

【手続補正書】
【提出日】令和3年9月13日(2021.9.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
第２の比較例に係る光源システムは、図１の第１の比較例に係る測距システムに対して、０次光対策のために０次光補正素子５を備えている。０次光補正素子５は、光学回折素子２００とは別体として設けられている。０次光補正素子５は、光学回折素子２００からの０次光Ｌ０を低減するために、光学回折素子２００の０次光Ｌ０を低減するパターン（光学回折素子２００に形成された所定のパターンとは逆のパターン）を有している。しかしながら、この手法では光学回折素子２００と０次光補正素子５とが別体として設けられているため、互いに形成されたパターン同士の位置合わせが困難であり、歩留りが低くなってしまう問題がある。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４２】
また例えば、図８に示した第２の変形例に係る光学回折素子２Ｂのように、一方の面２１に形成された回折格子部６Ｂが、所定パターンの開口としてランダム孔２３Ｂを有する構成であってもよい。この場合、他方の面２２にはランダム孔２３Ｂに対応するランダムパターンの０次光補正部２４Ｂを形成する。